

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年2月12日(12.02.2015)



(10) 国際公開番号

WO 2015/019661 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 31/00 (2006.01) B24C 3/26 (2006.01)
B24B 31/02 (2006.01) H01F 41/04 (2006.01)
B24B 31/06 (2006.01) H01G 13/00 (2013.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/058508
- (22) 国際出願日: 2014年3月26日(26.03.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-165742 2013年8月9日(09.08.2013) JP
特願 2013-273642 2013年12月28日(28.12.2013) JP
- (71) 出願人: 新東工業株式会社(SINTOKOGIO, LTD.)
[JP/JP]; 〒4600003 愛知県名古屋市中区錦一丁目
11番11号 Aichi (JP).
- (72) 発明者: 前田 和良(MAEDA Kazuyoshi); 〒4901144
愛知県海部郡大治町大字西條字附田71番地の2
新東工業株式会社大治事業所内 Aichi (JP).
澁谷 紀仁(SHIBUYA Norihito); 〒4901144 愛知県
海部郡大治町大字西條字附田71番地の2 新
東工業株式会社大治事業所内 Aichi (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et
al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番

1号丸の内 MY PLAZA (明治安田生命
ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo
(JP).

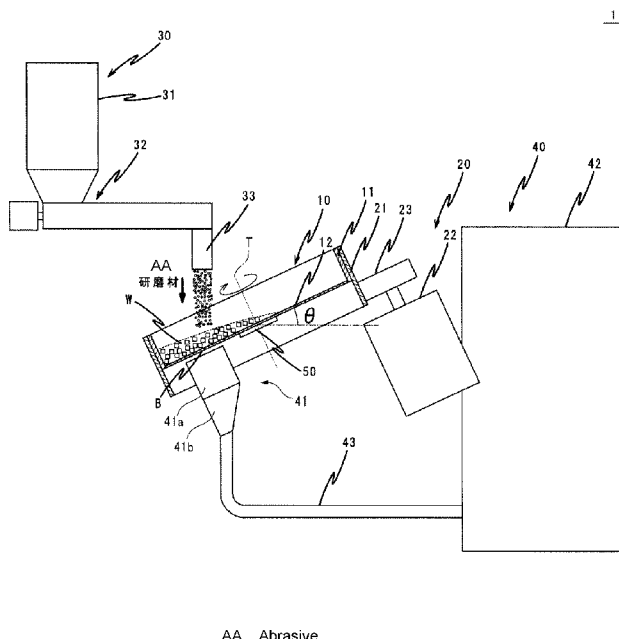
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: POLISHING DEVICE AND POLISHING METHOD

(54) 発明の名称: 研磨装置および研磨方法



(57) Abstract: The polishing device (1) is provided with: a processing vessel (10) into which the workpieces are inserted; a mobilization unit for mobilizing the workpieces inside the processing vessel; an abrasive-charging unit (30) for charging the abrasive in the direction of the workpieces; and a suction unit (40) for generating an air flow in which the abrasive moves in the direction that passes through the processing vessel (10) and for recovering the abrasive by suction. As a result of the air flow generated by the suction unit (40), the abrasive charged from the abrasive-charging unit (30) passes between the workpieces inserted in the processing vessel (10) while contacting the workpieces. The workpieces are thereby polished.

(57) 要約: 研磨装置1は、被加工物を装入する加工容器10と、加工容器内において被加工物を流動させる流動化ユニットと、研磨材を被加工物に向けて投入させる研磨材投入ユニット30と、研磨材が加工容器10を通過する方向に向かう気流を発生させると共に、研磨材を吸引して回収する吸引ユニット40と、を備える。研磨材投入ユニット30から投入された研磨材は、吸引ユニット40から発生する気流によって、加工容器10内に装入された被加工物の間を、被加工物に接触しながら通過す

る。これにより、被加工物が研磨される。